

ナノインプリント装置

Ver.1

小型 ローコスト
フルマニュアル

真空UV式

Vacuum mini

EVN-5150

高輝度
UV-LEDライト
採用



★真空雰囲気でのUVインプリント

★最大6インチ角のモールド搭載可能

★最大5000Nの転写力

小型・低価格

減圧状態によらない定圧インプリント
を実現（特許申請済み）

研究開発向けの本格NIL装置

真空UV式

Vacuum mini

ナノインプリント装置

Ver.1

■装置仕様 EVN-5150

ワーク	樹脂フィルムシート、ガラス、樹脂基板など 最大 150mm×150mm	
モールド	石英、金属、樹脂など 有効成形寸法 100mm×100mm	
到達真空度	100Pa	
上ヘッド	UV 光源	UV-LED
	UV 波長、強度	365±5nm 6mW/cm ² (参考値) 375±5nm 10mW/cm ² (参考値)に変更可。
	UV 照射範囲	100mm×100mm(中央部 50mm×50mm 内で照射ムラ Δ20% 以内)
	石英天板	合成石英 平面度 2μm 鏡面仕上げ
下ステージ	押圧機構	エアシリンダー
	転写力	250 ~ 5000N
	ステージ性能	ステンレス鋼 平面度 2μm 鏡面仕上げ
	ステージ機能	速度調節、平行調整機構付き
安全機構	前面扉を開くと動作停止、UV 消灯インターロック機能 UV 波長カットカバー使用	
装置寸法	W650mm×D470mm×H1300mm(真空ポンプを除く)	
装置重量	約 250kg(真空ポンプを除く)	
ユーティリティ	単相 AC100V 50/60Hz 最大 15A クリーンドライエア 0.55MPa 以上	
付属品	オイルロータリー式真空ポンプ	
オプション	ハイパワー UV-LED 365±5nm 100mW/cm ² (参考値)	

- 仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
- この印刷物の内容は、2011年6月現在のものです。

この商品のご用命は

カスタム仕様のご要望は下記まで

設計・製造元



エンジニアリングシステム株式会社

〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83
TEL.0263-26-1212・FAX.0263-26-1213
E-mail:sales@engineeringsystem.co.jp

弊社では、さまざまな自動機を設計・製作しております。お客様のご要望に沿った装置を製作します。何なりとお問い合わせください。

<http://www.engineeringsystem.co.jp/>